

## УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ХОУ ДЛЯ РАСЧЕТА ЧАСТИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ СИСТЕМЫ ПРОВОДНИКОВ

*Запропоновано новий спосіб вдосконалення методу Хоу для розрахунку часткових ємностей системи провідників. На прикладі системи паралельних циліндричних провідників показано, що даний метод є більше точним у порівнянні із класичним методом Хоу.*

*Предложено новый способ усовершенствования метода Хоу для расчета частичных емкостей системы проводников. На примере системы параллельных цилиндрических проводников показано, что данный метод является более точным по сравнению с классическим методом Хоу.*

### ВВЕДЕНИЕ

Задача нахождения частичных емкостей в системе проводников может быть строго решена на основе расчета электростатического поля рассматриваемой системы. Для расчета электростатического поля, используя группы формул Максвелла, необходимо знать распределение потенциала и заряда проводников, что не всегда возможно. Поэтому в тех случаях, когда расчет электростатического поля не может быть выполнен, используются специальные методы расчета емкости, основанные на установлении точной или приближенной связи заряда проводника непосредственно с потенциалом его поверхности, среди которых выделяют методы непосредственного определения емкости и вспомогательные методы и оценки. [1]

Методы непосредственного определения емкости применимы в тех случаях, когда проводники расположены в однородной или кусочно-однородной среде. Эти методы основаны на замене каждого из рассматриваемых проводников диэлектрическим телом, имеющим ту же форму, что и проводник, и ту же диэлектрическую проницаемость, что и окружающая среда. При этом вместо неизвестного истинного (равновесного) распределения заряда по поверхности проводника задается некоторое фиктивное распределение заряда по поверхности тела или в его объеме.

Вспомогательные методы основаны на геометрическом преобразовании проводников (при котором значения емкостей остаются постоянными или изменяются известным образом) с целью свести задачу определения емкостей к виду, доступному для расчетов либо методами непосредственного определения емкости, либо путем предварительного расчета электростатического поля; или определяют пределы, в которых находится истинное значение емкости.

Из всех методов расчета емкостей более подробно остановимся на методе средних потенциалов, который позволяет довольно просто определить значения частичных емкостей в системах цилиндрических проводников, применимых, например, в системах беспроводной передачи энергии при помощи тесловских процессов. [2-3]

### УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ХОУ

Метод средних потенциалов основан на задании фиктивного распределения заряда по поверхности или в объеме тел, заменяющих проводники. При этом поверхности каждого из тел приписывается постоянный потенциал, равный среднему арифметическому значений потенциала во всех точках поверхности тела ( $U = U_{cp}$ ). Эту величину ( $U_{cp}$ ) называют средним потенциалом поверх-

ности или средним потенциалом проводника.

Наиболее распространенным является допущение о том, что заряд распределен по поверхности тела равномерно. Основанный на этом допущении метод расчета емкости был предложен Г. Хоу и носит его имя.

Реальное распределение заряда вдоль проводника будет отличаться от равномерного, что вносит дополнительную погрешность в расчет частичных емкостей. Равномерное распределение в методе Хоу было принято для упрощения расчета. С развитием вычислительной техники вопросы сложности математических расчетов стоят не так остро, поэтому для увеличения точности можно задаться более сложным законом распределения заряда.

Рассмотрим для примера расчет частичных емкостей в системе проводников рис. 1.

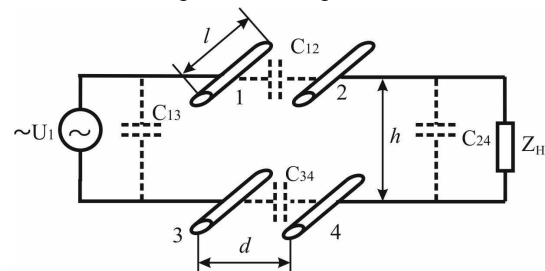


Рис. 1

Для системы проводников потенциалы на поверхности проводников связаны с их зарядами первой группой формул Максвелла:

$$\begin{aligned} U_1 &= \alpha_{11} \cdot Q_1 + \alpha_{12} \cdot Q_2 + \dots + \alpha_{1n} \cdot Q_n; \\ U_2 &= \alpha_{21} \cdot Q_1 + \alpha_{22} \cdot Q_2 + \dots + \alpha_{2n} \cdot Q_n; \end{aligned} \quad (1)$$

$$\dots$$

$$U_n = \alpha_{n1} \cdot Q_1 + \alpha_{n2} \cdot Q_2 + \dots + \alpha_{nn} \cdot Q_n;$$

где потенциальные коэффициенты  $\alpha_{ij}$  определяются согласно методу средних потенциалов по формулам

$$\alpha_{ij} = -\frac{\varphi_{cp ij}}{Q_{cp i}}; \quad (2)$$

Значение частичных емкостей определяется по формулам [4]

$$C_{ik} = -\frac{\Delta_{ik}}{\Delta}; \quad C_{kk} = \sum_{j=1}^n \frac{\Delta_{kj}}{\Delta}; \quad (3)$$

где  $\Delta$  – определитель матрицы потенциальных коэффициентов;  $\Delta_{ik}$  – алгебраическое дополнение.

Как известно [5] потенциал, создаваемый проводником длиной  $l$  и радиусом  $a$  в точке А (рис.2), определяется выражением:

$$\varphi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\tau(x)dx}{\sqrt{y^2 + (x_0 - x)^2}}. \quad (4)$$

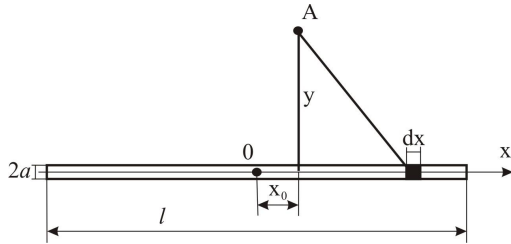


Рис. 2

Пусть линейная плотность заряда непостоянна вдоль проводника, размещенного по оси  $x$ , а определяется выражением:

$$\tau(x) = \tau_0 + \sum_{i=1}^n b_i \cdot x^{2i} \quad (5)$$

где  $\tau_0$  – линейная плотность заряда в центре проводника;  $b_i$  – коэффициенты аппроксимации;  $n$  – количество членов ряда.

Так как распределение заряда симметрично относительно центра проводника, то при выборе функции распределения учитываем только четные степени  $x$ .

Для нахождения распределения зарядов воспользуемся условием равенства потенциала в любых точках поверхности проводника.

Заряд на малом отрезке проводника  $dx$  можно считать сосредоточенным на оси отрезка, тогда на поверхности проводника потенциал будет равен

$$\varphi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\tau(x)dx}{\sqrt{a^2 + (x_0 - x)^2}} \quad (6)$$

Для уменьшения времени затрачиваемого при машинном расчете, лучше перейти к безразмерным величинам

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x}{0,5 \cdot l}; & x'_0 &= \frac{x_0}{0,5 \cdot l}; & a' &= \frac{a}{0,5 \cdot l}; \\ b'_i &= \frac{b_i}{\tau_0}; & d' &= \frac{d}{0,5 \cdot l}; & h' &= \frac{h}{0,5 \cdot l}; \end{aligned} \quad (7)$$

$$\varphi'(x') = \frac{\varphi(x')}{\tau_0 / 4\pi\epsilon_0} = \int_{-1}^1 \frac{1 + \sum_{i=1}^n b'_i \cdot x'^{2i}}{\sqrt{a'^2 + (x'_0 - x')^2}} dx' \quad (8)$$

Для нахождения  $b_i$  необходимо задаться количеством членов ряда  $n$ , а также соответствующими координатами выбранных точек  $\bar{X}_\Gamma = (0; x_1; x_2; \dots; x_n)$ , потенциалы которых будут равны между собой. Решая систему полученных уравнений, находим значения  $b_i$

$$\begin{cases} \varphi(0) - \varphi(x_1) = 0; \\ \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = 0; \\ \vdots \\ \varphi(x_{n-1}) - \varphi(x_n) = 0, \end{cases} \quad (9)$$

где  $\varphi(x_i)$  – потенциал на поверхности проводника в  $i$ -ой выбранной точке.

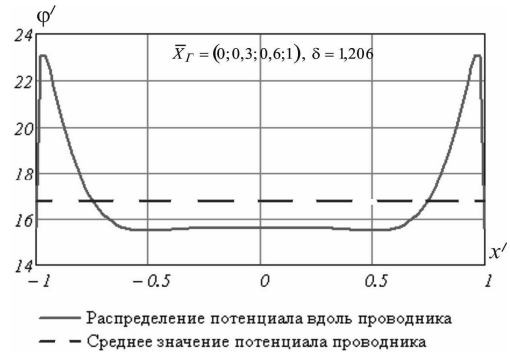
При нахождении коэффициентов  $b_i$  важную роль

играет выбор точек, в которых должно обеспечиваться равенство потенциала, а также количество членов ряда  $n$  (рис. 3).

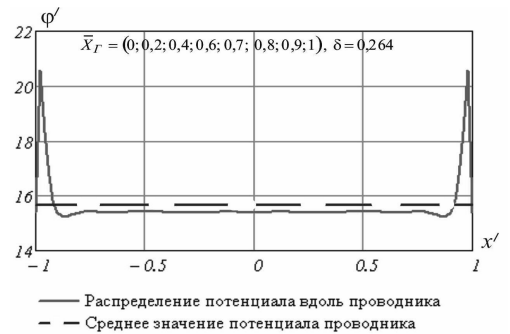
Для определения равномерности распределения потенциала по поверхности проводника воспользуемся среднеквадратичной ошибкой:

$$\delta = \int_0^1 \sqrt{(\varphi'(x') - \varphi'(0))^2} \cdot dx'. \quad (10)$$

Минимальное значение  $\delta$  соответствует наиболее рациональному размещению выбранных точек.



а



б

Рис. 3

На рис. 4 показано распределение потенциала вдоль проводника при  $n = 12$  для следующих точек  $\bar{X}_\Gamma = (0; 0,08; 0,16; 0,24; 0,32; 0,4; 0,48; 0,81; 0,86; 0,87; 0,94; 0,97)$ . В данном случае среднеквадратичная ошибка  $\delta$  не превышает 2 %, распределение потенциала по поверхности практически равномерно, а коэффициенты  $b_i$  имеют следующие значения для  $a = 1$  мм,  $l = 30$  см,  $h = 30$  см,  $d = 3$  см:

$$\begin{aligned} b'_1 &= 0,073; & b'_2 &= 0,044; & b'_3 &= 0,055; & b'_4 &= -0,552; \\ b'_5 &= 7,496; & b'_6 &= -52,493; & b'_7 &= 208,573; & b'_8 &= -474,686; \\ b'_9 &= 612,359; & b'_{10} &= -416,263; & b'_{11} &= 115,988. \end{aligned}$$

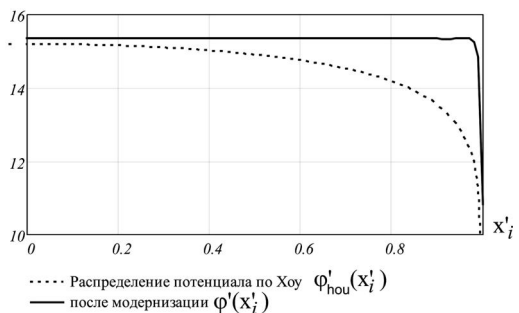


Рис. 4

После определения коэффициентов  $b_i$ ; средний заряд проводника определяется по формуле:

$$Q_{\text{ср}} = \int_{-0,5l}^{0,5l} \tau(x) \cdot dx = \tau_0 \cdot \frac{l}{2} \cdot \int_{-1}^1 \left( 1 + \sum_{i=1}^n b'_i \cdot x'^{2i} \right) dx' \quad (11)$$

График распределения заряда вдоль проводника представлен на рис. 5.

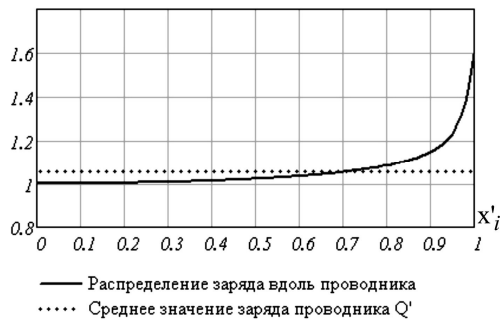


Рис. 5

Для системы проводников рис. 1, учитывая, что все проводники одинаковы и расположены параллельно друг другу, потенциал, создаваемый зарядом проводника 1 в точке  $x'_0$  на поверхности проводников 2, 3 и 4 соответственно, будет равняться

$$\begin{aligned} \Phi'_{12}(x'_0) &= \int_{-1}^1 \frac{1 + \sum_{i=1}^n b'_i \cdot x'^{2i}}{\sqrt{d'^2 + (x'_0 - x')^2}} dx'; \\ \Phi'_{13}(x'_0) &= \int_{-1}^1 \frac{1 + \sum_{i=1}^n b'_i \cdot x'^{2i}}{\sqrt{h'^2 + (x'_0 - x')^2}} dx'; \\ \Phi'_{14}(x'_0) &= \int_{-1}^1 \frac{1 + \sum_{i=1}^n b'_i \cdot x'^{2i}}{\sqrt{d'^2 + h'^2 + (x'_0 - x')^2}} dx'. \end{aligned} \quad (12)$$

Средние значения потенциалов на поверхности проводников 2, 3 и 4 соответственно, будут равняться

$$\begin{aligned} \Phi'_{\text{ср}12} &= \int_0^1 \Phi'_{12}(x'_0) dx'_0; \\ \Phi'_{\text{ср}13} &= \int_0^1 \Phi'_{13}(x'_0) dx'_0; \quad \Phi'_{\text{ср}14} = \int_0^1 \Phi'_{14}(x'_0) dx'_0. \end{aligned} \quad (13)$$

Используя полученные формулы для определения средних зарядов и потенциалов, можно определить потенциальные коэффициенты, по которым рассчитывать частичные емкости.

Результаты расчета частичных емкостей для системы проводников (рис. 1) при  $a = 1$  мм,  $l = 30$  см,  $h = 30$  см,  $d = 3$  см для классического метода Хоу и усовершенствованного представлены в табл. 1.

Таблица 1

Частичная емкость	$C_{11}$ , пФ	$C_{12}$ , пФ	$C_{13}$ , пФ	$C_{14}$ , пФ
Метод Хоу	1,617	0,7066	0,08979	0,08852
усовершенствованный	1,626	0,7071	0,09062	0,08934

## ВЫВОДЫ

Предложен новый способ усовершенствования метода средних потенциалов, который предполагает использование более сложного закона распределения заряда вдоль проводника.

Предложенный способ проиллюстрирован на примере расчета частичных емкостей в системе параллельных цилиндрических проводников.

Оказалось, что величина частичных емкостей в данном случае выше, чем в классическом методе Хоу. Известно, что классический метод Хоу дает заниженное значение емкости [1], поэтому предлагаемые усовершенствования позволяют повысить точность определения частичных емкостей в системе многих проводников.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчет электрической ёмкости. – Л.: Энергоиздат, 1981. – 288 с.
2. Пентегов И.В., Приступа А.Л. О возможности беспроводной передачи энергии с помощью тесловских процессов // Техническая электродинамика. – 2005. – № 3. – С. 11-15.
3. Пентегов И.В., Приступа А.Л. Аналіз теслівських процесів при передачі енергії без проводів // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – 2005. – № 25. – С. 116-122.
4. Шимони К. Теоретическая электротехника. – М.: Мир, 1964. – 775 с.
5. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М.: Высш. шк., 1983. – 463 с.

**Bibliography (transliterated):** 1. Iossel' Yu.Ya., Kochanov `E.S., Strunskij M.G. Raschet `elektricheskoy emkosti. - L.: `Energoizdat, 1981. - 288 s. 2. Pentegov I.V., Pristupa A.L. O vozmozhnosti besprovodnoj peredachi `energii s pomosh'yu teslovskih processov // Tehnicheskaya `elektrodinamika. - 2005. - № 3. - S. 11-15. 3. Pentegov I.V., Pristupa A.L. Analiz teslivs'kih procesiv pri peredachi energii bez provodiv // Visnik Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Zbirnik. - 2005. - № 25. - S. 116-122. 4. Shimoni K. Teoreticheskaya `elektrotehnika. - M.: Mir, 1964. - 775 s. 5. Matveev A.N. `Elektrichestvo i magnetizm. - M.: Vyssh. shk., 1983. - 463 s.

Поступила 14.10.2011

*Пентегов Игорь Владимирович, д.т.н., проф.*

Институт электросварки им. Е.О.Патона  
отдел электротермии  
03680, Киев-150, ул. Боженко, 11  
тел. (044) 287-23-88, e-mail: i.v.pentegov@gmail.com

*Приступа Анатолий Леонидович, к.т.н.*

Черниговский государственный технологический университет  
кафедра физики  
14000, Чернигов, ул. Шевченко, 95  
тел. (04622) 3-22-99, e-mail: prystol@ukr.net

*Pentegov I.V., Prystupa A.L.*

### An improved Hou method for calculation of partial capacitance of a system of conductors.

The paper presents a new procedure for improving Hou method for calculating partial capacitance of a system of conductors. With an example of a system of parallel cylindrical conductors, it is shown that this method is more accurate than the classical Hou method.

**Key words – Tesla processes, wireless transmission, Maxwell's equations, partial capacitance.**